

# Deutsche Akkreditierungsstelle

## Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-19933-01-00 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

**Gültig ab:** 19.04.2024

Ausstellungsdatum: 19.04.2024

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

**SphereOptics GmbH**  
**Gewerbestr. 13, 82211 Herrsching am Ammersee**

mit dem Standort

**SphereOptics GmbH**  
**Gewerbestr. 13, 82211 Herrsching am Ammersee**

Das Kalibrierlaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Kalibrierlaboratorium erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Kalibrierlaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Kalibrierungen in den Bereichen:

**Hochfrequenz- und Strahlungsmessgrößen**  
**Optische Messgrößen**  
– Radiometrie

*Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen ([www.dakks.de](http://www.dakks.de))*

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-19933-01-00

**Permanentes Laboratorium**

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit		
<b>Radiometrie</b> spektraler Reflexionsgrad	(für Wellenlängen 250 nm bis 320 nm):	optische Spektrometrie			in der Geometrie 8° / d bzw. 8° / h  d: diffus h: hemisphärisch  Die Angaben der erweiterten Messunsicherheit entsprechen Absolutwerten.
	0,5 % bis 20 %		1,01 %		
	> 20 % bis 40 %		1,15 %		
	> 40 % bis 60 %		1,32 %		
	> 60 % bis 80 %		1,43 %		
	> 80 % bis 100 %		1,56 %		
	(für Wellenlängen > 320 nm bis 1250 nm):				
	0,5 % bis 20 %		0,38 %		
	> 20 % bis 40 %		0,42 %		
	> 40 % bis 60 %		0,52 %		
	> 60 % bis 80 %		0,48 %		
	> 80 % bis 100 %		0,5 %		
	(für Wellenlängen > 1250 nm bis 1750 nm):				
	0,5 % bis 20 %		0,51 %		
	> 20 % bis 40 %		0,55 %		
	> 40 % bis 60 %		0,63 %		
	> 60 % bis 80 %		0,59 %		
	> 80 % bis 100 %		0,61 %		
	(für Wellenlängen > 1750 nm bis 2300 nm):				
	0,5 % bis 20 %		0,92 %		
	> 20 % bis 40 %		1,04 %		
	> 40 % bis 60 %		1,19 %		
	> 60 % bis 80 %		1,28 %		
	> 80 % bis 100 %		1,4 %		
	(für Wellenlängen > 2300 nm bis 2450 nm):				
	0,5 % bis 20 %		1,69 %		
	> 20 % bis 40 %		1,95 %		
	> 40 % bis 60 %		2,23 %		
> 60 % bis 80 %	2,48 %				
> 80 % bis 100 %	2,75 %				

**Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-19933-01-00**

**Verwendete Abkürzungen:**

CMC	Calibration and measurement capabilities (Kalibrier- und Messmöglichkeiten)
DIN	Deutsches Institut für Normung e.V.
EN	Europäische Norm
IEC	International Electrotechnical Commission – Internationale Elektrotechnische Kommission
ISO	International Organization for Standardization – Internationale Organisation für Normung